

关于研发机构采购设备税收政策的通知

(2009 年 10 月 10 日财政部、海关总署、国家税务总局发布 财税[2009]115 号)

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局,海关总署广东分署、各直属海关:

为了鼓励科学研究和技术开发,促进科技进步,经国务院批准,对外资研发中心进口科技开发用品免征进口税收,对内外资研发机构采购国产设备全额退还增值税。现将有关事项具体明确如下:

一、外资研发中心适用《科技开发用品免征进口税收暂行规定》(财政部、海关总署、国家税务总局令第 44 号)免征进口税收,根据其设立时间,应分别满足下列条件:

(一)对 2009 年 9 月 30 日及其之前设立的外资研发中心,应同时满足下列条件:

1. 研发费用标准:(1)对新设立不足两年的外资研发中心,作为独立法人的,其投资总额不低于 500 万美元;作为公司内设部门或分公司的,其研发总投入不低于 500 万美元;(2)对设立两年及以上的外资研发中心,企业研发经费年支出额不低于 1000 万元。

2. 专职研究与试验发展人员不低于 90 人。

3. 设立以来累计购置的设备原值不低于 1000 万元。

(二)对 2009 年 10 月 1 日及其之后设立的外资研发中心,应同时满足下列条件:

1. 研发费用标准:作为独立法人的,其投资总额不低于 800 万美元;作为公司内设部门或分

公司的,其研发总投入不低于 800 万美元。

2. 专职研究与试验发展人员不低于 150 人。

3. 设立以来累计购置的设备原值不低于 2000 万元。

具体审核办法由商务部会同财政部、海关总署、国家税务总局另行制定。

二、适用采购国产设备全额退还增值税政策的内外资研发机构包括:

(一)《科技开发用品免征进口税收暂行规定》(财政部、海关总署、国家税务总局令第 44 号)规定的科学研究、技术开发机构。

(二)《科学研究和教学用品免征进口税收规定》(财政部、海关总署、国家税务总局令第 45 号)规定的科学研究机构和学校。

(三)符合本通知第一条规定条件的外资研发中心。

具体退税管理办法由国家税务总局会同财政部另行制定。

三、本通知所述设备,是指本通知附件所列的为科学研究、教学和科技开发提供必要条件的实验设备、装置和器械。

四、本通知执行期限为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

附件:科技开发、科学研究和教学设备清单

财政部 海关总署 国家税务总局

二〇〇九年十月十日

附件:

科技开发、科学研究和教学设备清单

为科学研究、教学和科技开发提供必要条件的实验设备、装置和器械(不包括中试设备),具体包括以下三类:

一、实验环境方面

- (一)教学实验仪器及装置;
- (二)教学示教、演示仪器及装置;
- (三)超净设备(如换气、灭菌、纯水、净化设备等);
- (四)特殊实验环境设备(如超低温、超高温、高压、低压、强腐蚀设备等);
- (五)特殊电源、光源(如电极、开关、线圈、各种光源等);
- (六)清洗循环设备;
- (七)恒温设备(如水浴、恒温箱、灭菌仪等);
- (八)小型粉碎、研磨制备设备。

二、样品制备设备和装置

- (一)特种泵类(如分子泵、离子泵、真空泵、蠕动泵、蜗轮泵、干泵等);
- (二)培养设备(如培养箱、发酵罐等);
- (三)微量取样设备(如移液管、取样器、精密天平等);
- (四)分离、纯化、浓缩设备(如离心机、层析、色谱、萃取、结晶设备、旋转蒸发器等);
- (五)气体、液体、固体混合设备(如漩涡混合

器等);

(六)制气设备、气体压缩设备;

(七)专用制样设备(如切片机、压片机、镀膜机、减薄仪、抛光机等),实验用注射、挤出、造粒、膜压设备;实验室样品前处理设备;

(八)实验室专用小器具(如分配器、量具、循环器、清洗器、工具等)。

三、实验室专用设备

(一)特殊照相和摄影设备(如水下、高空、高温、低温等);

(二)科研飞机、船舶用关键设备和部件;

(三)特种数据记录设备及材料(如大幅面扫描仪、大幅面绘图仪、磁带机、光盘机等);

(四)特殊电子部件(如电路板、特种晶体管、专用集成电路等);

(五)材料科学专用设备(如干胶仪、特种坩埚、陶瓷、图形转换设备、制版用干板、特种等离子体源、离子源、外延炉、扩散炉、溅射仪、离子刻蚀机,材料实验机等),可靠性试验设备,微电子加工设备,通信模拟仿真设备,通信环境试验设备;

(六)小型熔炼设备(如真空、粉末、电渣等),特殊焊接设备;

(七)小型染整、纺丝试验专用设备;

(八)电生理设备。